



检测报告

报告编号 A2190339094152CQ003

第 1 页 共 40 页

委托单位 无锡华润上华科技有限公司

受检单位 无锡华润上华科技有限公司

受检单位地址 无锡市新吴区新洲路 8 号

样品类型 工业废气

报告用途 自检

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.1884242437

报告说明

报告编号 A2190339094152CQ003

第 2 页 共 40 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 除客户特别声明本报告只适用于本次采集/收到的受检样品，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。委托方对受检样品及其相关信息的真实性负责。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. A2190339094152CQ003 引用报告编号为 A2190339094152CQ001 的检测结果。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

徐金艳

签

发：

乔杰

签发人姓名：

乔杰

审

核：

戴利利

签发日期：

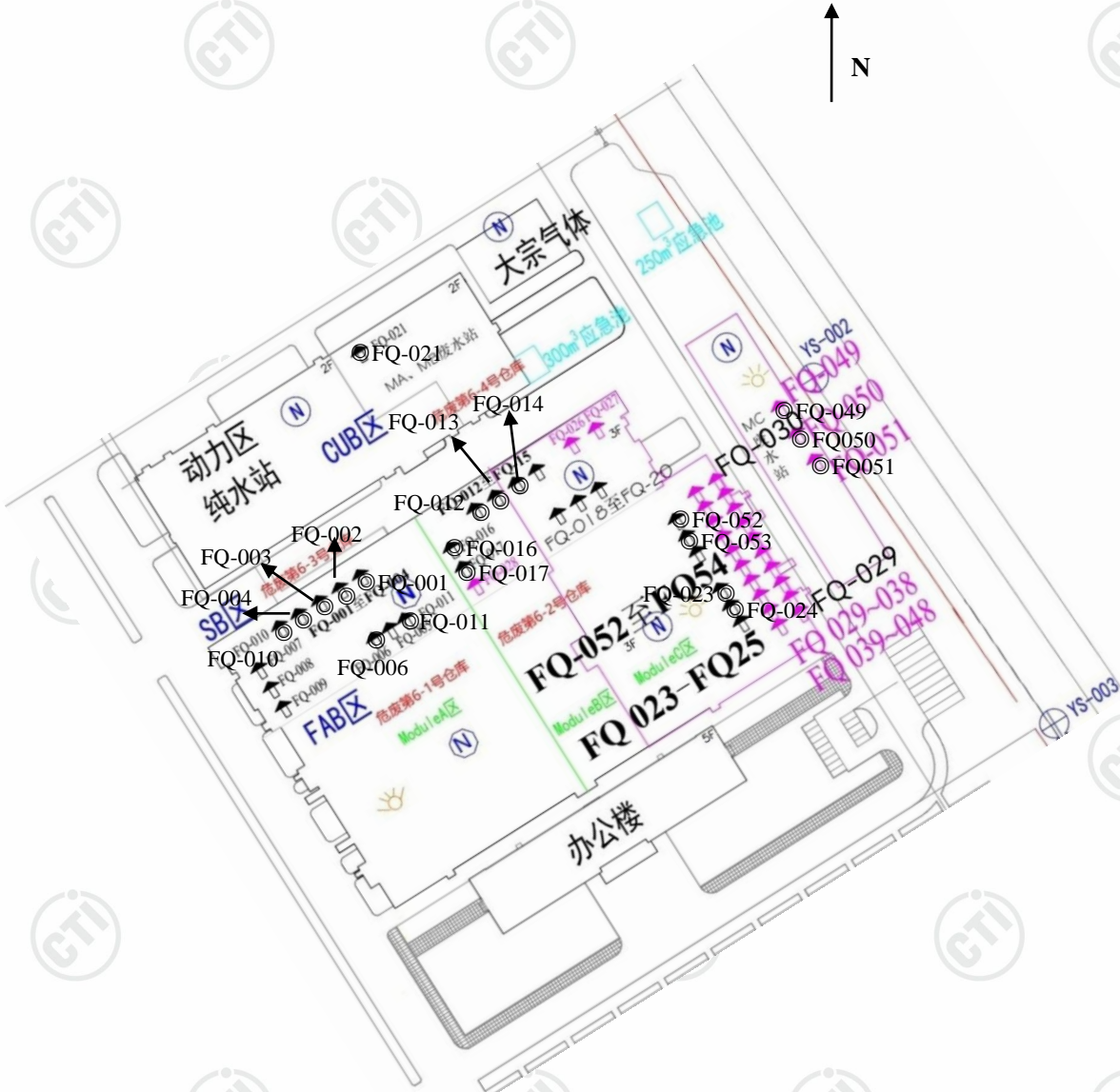
2023/03/29

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003

第 3 页 共 40 页

附：检测布点图



说明：◎工业废气有组织采样点

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003 第 4 页 共 40 页

表 1:

样品信息:										
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		张立广、石世端				
采样日期		2023-02-27		检测日期		2023-02-27~2023-03-02				
采样方式		连续		样品状态		完好				
检测结果:										
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m		
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h			
FQ-001	氟化物	SUP22401004	0.18	8.77×10 ⁻³	46136	1.5	---	33.5		
		SUP22401005	0.19							
		SUP22401006	0.19							
		平均值	0.19							
	氮氧化物	SUP22401001	ND	/	48720	50 ^a	---			
		SUP22401002	ND							
		SUP22401003	ND							
		平均值	ND							
	氯化氢	SUP22401010	0.80	0.135	48720	10	---			
		SUP22401011	1.50							
		SUP22401012	6.03							
		平均值	2.78							
	氯气	SUP22401013	0.9	5.11×10 ⁻²	46453	5.0	---			
		SUP22401014	0.9							
		SUP22401015	1.5							
		平均值	1.1							
	硫酸雾	SUP22401007	ND	1.27×10 ⁻²	48720	5.0	---			
		SUP22401008	0.40							
		SUP22401009	0.29							
		平均值	0.26							

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003

第 5 页 共 40 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h
SUP22401001/ 007/010/013	18	10.5	103.4	1.3273	45974
SUP22401002/ 008/011	18	11.4	103.3	1.3273	49862
SUP22401003/ 009/012	18	11.5	103.3	1.3273	50325
SUP22401004/ 014	18	10.4	103.3	1.3273	45374
SUP22401005	18	10.3	103.2	1.3273	45023
SUP22401006/ 015	18	11.0	103.2	1.3273	48010
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3				
备注：1.FQ-001 管道直径 1.30m，采样孔位于弯道下游 360cm，采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。 5.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 6.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 7.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003 第 6 页 共 40 页

表 2:

样品信息:										
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		沈鑫林、张权芝				
采样日期		2023-02-27		检测日期		2023-02-27~2023-03-02				
采样方式		连续		样品状态		完好				
检测结果:										
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流量 m ³ /h	参照标准限值		排气筒高度 m		
						排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h			
FQ-002	氟化物	SUP22401019	0.18	5.84×10 ⁻³	32442	1.5	---	33.5		
		SUP22401020	0.18							
		SUP22401021	0.18							
		平均值	0.18							
	氮氧化物	SUP22401016	ND	/	32367	50 ^a	---			
		SUP22401017	ND							
		SUP22401018	ND							
		平均值	ND							
	氯化氢	SUP22401025	1.22	5.86×10 ⁻²	32535	10	---			
		SUP22401026	2.89							
		SUP22401027	1.30							
		平均值	1.80							
	氯气	SUP22401028	0.9	2.60×10 ⁻²	32479	5.0	---			
		SUP22401029	0.8							
		SUP22401030	0.8							
		平均值	0.8							
	硫酸雾	SUP22401022	ND	/	32367	5.0	---			
		SUP22401023	0.24							
		SUP22401024	ND							
		平均值	ND							

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003

第 7 页 共 40 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h
SUP22401016/ 022/025/026/ 028	17	7.4	103.6	1.3273	32702
SUP22401017/ 023/027	17	7.3	103.6	1.3273	32201
SUP22401018/ 024	17	7.3	103.6	1.3273	32199
SUP22401019/ 029	17	7.4	103.6	1.3273	32593
SUP22401020	17	7.4	103.6	1.3273	32592
SUP22401021/ 030	18	7.3	103.5	1.3273	32142
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3				
备注：1.FQ-002 管道直径 1.30m，采样孔位于变径处下游 360cm，采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。 5.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 6.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 7.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003 第 8 页 共 40 页

表 3:

样品信息:										
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		沈鑫林、张权芝				
采样日期		2023-02-27		检测日期		2023-02-27~2023-03-02				
采样方式		连续		样品状态		完好				
检测结果:										
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m		
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h			
FQ-003	氟化物	SUP22401034	0.19	4.89×10 ⁻³	25728	1.5	---	33.5		
		SUP22401035	0.19							
		SUP22401036	0.19							
		平均值	0.19							
	氮氧化物	SUP22401031	ND	/	25585	50 ^a	---			
		SUP22401032	ND							
		SUP22401033	ND							
		平均值	ND							
	氯化氢	SUP22401040	0.99	3.20×10 ⁻²	25585	10	---			
		SUP22401041	1.15							
		SUP22401042	1.60							
		平均值	1.25							
	氯气	SUP22401043	1.3	4.35×10 ⁻²	25587	5.0	---			
		SUP22401044	2.1							
		SUP22401045	1.8							
		平均值	1.7							
	硫酸雾	SUP22401037	0.25	1.05×10 ⁻²	25585	5.0	---			
		SUP22401038	0.52							
		SUP22401039	0.46							
		平均值	0.41							

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003

第 9 页 共 40 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h
SUP22401031/ 037/040/043	18	5.8	103.3	1.3273	25452
SUP22401032/ 038/041	18	5.8	103.3	1.3273	25438
SUP22401033/ 039/042	18	5.9	103.2	1.3273	25865
SUP22401034/ 044	17	5.9	103.2	1.3273	25894
SUP22401035	17	5.9	103.2	1.3273	25875
SUP22401036/ 045	17	5.8	103.2	1.3273	25416
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3				
备注：1.FQ-003 管道直径 1.30m，采样孔位于弯道下游 360cm，采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。 5.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 6.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 7.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003 第 10 页 共 40 页

表 4:

样品信息:								
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		徐杰、汪蔚		
采样日期		2023-02-27		检测日期		2023-02-27~2023-03-02		
采样方式		连续		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流量 m ³ /h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	
FQ-004	氟化物	SUP22401049	0.16	8.56×10 ⁻³	50372	1.5	---	33.5
		SUP22401050	0.18					
		SUP22401051	0.16					
		平均值	0.17					
	氮氧化物	SUP22401046	6	0.204	50933	50 ^a	---	
		SUP22401047	3					
		SUP22401048	ND					
		平均值	4					
	氯化氢	SUP22401055	1.42	7.95×10 ⁻²	51320	10	---	
		SUP22401056	1.40					
		SUP22401057	1.84					
		平均值	1.55					
	氯气	SUP22401058	1.1	7.10×10 ⁻²	50739	5.0	---	
		SUP22401059	1.4					
		SUP22401060	1.6					
		平均值	1.4					
	硫酸雾	SUP22401052	0.26	1.33×10 ⁻²	51320	5.0	---	
		SUP22401053	ND					
		SUP22401054	0.41					
		平均值	0.26					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003

第 11 页 共 40 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h
SUP22401046/ 053/056	17	11.6	103.2	1.3273	51539
SUP22401047/ 054/057	17	11.5	103.2	1.3273	50936
SUP22401048/ 049/059	18	11.4	103.1	1.3273	50323
SUP22401050	18	11.4	103.1	1.3273	50386
SUP22401051/ 060	18	11.4	103.0	1.3273	50408
SUP22401052/ 055/058	17	11.6	103.3	1.3273	51486
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3				
备注：1.FQ-004 管道直径 1.30m，采样孔位于变径处下游 360cm，采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 5.排气筒高度由受检单位提供。 6.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003 第 12 页 共 40 页

表 5:

样品信息:										
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		徐杰、汪蔚				
采样日期		2023-02-27		检测日期		2023-02-27~2023-03-02				
采样方式		连续		样品状态		完好				
检测结果:										
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m		
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h			
FQ-010	氟化物	SUP22401064	0.21	3.57×10 ⁻³	17842	1.5	---	33.5		
		SUP22401065	0.19							
		SUP22401066	0.19							
		平均值	0.20							
	氮氧化物	SUP22401061	9	0.507	18111	50 ^a	---			
		SUP22401062	30							
		SUP22401063	45							
		平均值	28							
	氯化氢	SUP22401070	1.70	2.44×10 ⁻²	18185	10	---			
		SUP22401071	1.03							
		SUP22401072	1.30							
		平均值	1.34							
	氯气	SUP22401073	1.3	2.33×10 ⁻²	17930	5.0	---			
		SUP22401074	1.1							
		SUP22401075	1.4							
		平均值	1.3							
	硫酸雾	SUP22401067	0.72	8.33×10 ⁻³	18111	5.0	---			
		SUP22401068	0.41							
		SUP22401069	0.26							
		平均值	0.46							

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003

第 13 页 共 40 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h
SUP22401061/ 067/070/073	19	7.0	102.9	0.7854	18224
SUP22401062/ 068/071/072	19	7.0	102.9	0.7854	18166
SUP22401063/ 069	19	6.9	102.8	0.7854	17944
SUP22401064/ 074	19	6.9	102.8	0.7854	17885
SUP22401065	18	6.9	102.8	0.7854	17962
SUP22401066/ 075	18	6.8	102.8	0.7854	17680
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3				
备注：1.FQ-010 管道直径 1.00m，采样孔位于变径处下游 360cm，采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 5.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003 第 14 页 共 40 页

表 6:

样品信息:										
样品类型	工业废气（有组织）			采样人员	沈鑫林、张权芝					
采样日期	2023-02-28			检测日期	2023-02-28~2023-03-03					
采样方式	连续			样品状态	完好					
检测结果:										
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m		
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h			
FQ-012	氟化物	SUP22401079	0.20	6.56×10 ⁻³	32825	1.5	---	33.5		
		SUP22401080	0.20							
		SUP22401081	0.20							
		平均值	0.20							
	氮氧化物	SUP22401076	ND	/	32889	50 ^a	---			
		SUP22401077	ND							
		SUP22401078	ND							
		平均值	ND							
	氯化氢	SUP22401085	1.34	3.95×10 ⁻²	32889	10	---			
		SUP22401086	1.49							
		SUP22401087	0.78							
		平均值	1.20							
	氯气	SUP22401088	0.7	3.63×10 ⁻²	33009	5.0	---			
		SUP22401089	1.3							
		SUP22401090	1.2							
		平均值	1.1							
	硫酸雾	SUP22401082	0.31	1.05×10 ⁻²	32889	5.0	---			
		SUP22401083	0.29							
		SUP22401084	0.36							
		平均值	0.32							

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003

第 15 页 共 40 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h
SUP22401076/ 082/085/088	17	7.6	102.7	1.3273	33217
SUP22401077/ 083/086	18	7.5	102.7	1.3273	32746
SUP22401078/ 084/087	18	7.5	102.6	1.3273	32703
SUP22401079/ 089	18	7.5	102.6	1.3273	32664
SUP22401080	18	7.5	102.6	1.3273	32665
SUP22401081/ 090	17	7.6	102.5	1.3273	33145
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3				
备注：1.FQ-012 管道直径 1.30m，采样孔位于排气口上游 430cm，采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。 5.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 6.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 7.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003 第 16 页 共 40 页

表 7:

样品信息:										
样品类型	工业废气（有组织）			采样人员	徐杰、汪蔚					
采样日期	2023-02-28			检测日期	2023-02-28~2023-03-03					
采样方式	连续			样品状态	完好					
检测结果:										
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m		
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h			
FQ-013	氟化物	SUP22401094	0.17	7.06×10 ⁻³	39213	1.5	---	33.5		
		SUP22401095	0.17							
		SUP22401096	0.19							
		平均值	0.18							
	氮氧化物	SUP22401091	ND	0.152	37920	50 ^a	---			
		SUP22401092	3							
		SUP22401093	6							
		平均值	4							
	氯化氢	SUP22401100	1.79	8.34×10 ⁻²	37920	10	---			
		SUP22401101	3.91							
		SUP22401102	0.91							
		平均值	2.20							
	氯气	SUP22401103	1.3	4.23×10 ⁻²	38498	5.0	---			
		SUP22401104	1.2							
		SUP22401105	0.7							
		平均值	1.1							
	硫酸雾	SUP22401097	0.34	1.29×10 ⁻²	37920	5.0	---			
		SUP22401098	0.35							
		SUP22401099	0.34							
		平均值	0.34							

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003

第 17 页 共 40 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h
SUP22401091/ 097/100/103	18	8.6	102.8	1.3273	37928
SUP22401092/ 098/101	17	8.6	102.8	1.3273	37987
SUP22401093/ 099/102	18	8.6	102.8	1.3273	37844
SUP22401094/ 104	18	8.6	102.8	1.3273	37896
SUP22401095	18	9.1	102.8	1.3273	40072
SUP22401096/ 105	17	9.0	102.7	1.3273	39671
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3				
备注：1.FQ-013 管道直径 1.30m，采样孔位于排气口上游 430cm，采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。 5.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 6.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003 第 18 页 共 40 页

表 8:

样品信息:								
样品类型	工业废气（有组织）			采样人员	徐杰、汪蔚			
采样日期	2023-02-28			检测日期	2023-02-28~2023-03-03			
采样方式	连续			样品状态	完好			
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
FQ-014	氟化物	SUP22401109	0.18	5.84×10 ⁻³	32457	1.5	---	33.5
		SUP22401110	0.19					
		SUP22401111	0.17					
		平均值	0.18					
	氮氧化物	SUP22401106	ND	/	32439	50 ^a	---	
		SUP22401107	ND					
		SUP22401108	ND					
		平均值	ND					
	氯化氢	SUP22401115	2.14	0.111	32146	10	---	
		SUP22401116	1.31					
		SUP22401117	6.87					
		平均值	3.44					
	氯气	SUP22401118	1.1	2.56×10 ⁻²	32028	5.0	---	
		SUP22401119	0.5					
		SUP22401120	0.9					
		平均值	0.8					
	硫酸雾	SUP22401112	0.45	1.19×10 ⁻²	32146	5.0	---	
		SUP22401113	0.30					
		SUP22401114	0.37					
		平均值	0.37					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003

第 19 页 共 40 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h
SUP22401106/ 114/117	18	7.4	102.6	1.3273	32468
SUP22401107/ 109	19	7.4	102.5	1.3273	32374
SUP22401108/ 110/119	18	7.4	102.5	1.3273	32474
SUP22401111/ 120	17	7.4	102.5	1.3273	32522
SUP22401112/ 115/118	19	7.1	102.7	1.3273	31087
SUP22401113/ 116	18	7.5	102.6	1.3273	32884
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3				
备注：1.FQ-014 管道直径 1.30m，采样孔位于排气口上游 430cm，采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。 5.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 6.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 7.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003 第 20 页 共 40 页

表 9:

样品信息:								
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		张立广、崔凯杰		
采样日期		2023-02-28		检测日期		2023-02-28~2023-03-06		
采样方式		连续/瞬时		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
FQ-052	二氧化硫	SUP22401133	ND	/	16168	200	1.4	33.5
		SUP22401134	ND					
		SUP22401135	ND					
		平均值	ND					
	氮氧化物	SUP22401133	9	0.146	16168	100	0.47	
		SUP22401134	9					
		SUP22401135	9					
		平均值	9					
	颗粒物	SUP22401142	5.0	8.60×10 ⁻²	16233	20	1	
		SUP22401143	5.1					
		SUP22401144	5.7					
		平均值	5.3					
	异丙醇	SUP22401139	0.983	1.48×10 ⁻²	16979	40	---	
		SUP22401140	0.511					
		SUP22401141	1.12					
		平均值	0.871					
	非甲烷总烃	SUP22401136	1.98	3.28×10 ⁻²	16979	50	---	
		SUP22401137	1.78					
		SUP22401138	2.02					
		平均值	1.93					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003

第 21 页 共 40 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h
SUP22401133/ 136/137/139/ 140/142	38	7.2	102.3	0.7854	17790
SUP22401134/ 135/138/141/ 143	48	6.4	102.3	0.7854	15357
SUP22401144	49	6.5	102.3	0.7854	15552
参照标准	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 1 大气污染物有组织排放限值 异丙醇、非甲烷总烃：《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3				
备注：1.氮氧化物、二氧化硫为现场检测。 2.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。 3.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 4.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 5.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003 第 22 页 共 40 页

表 10:

样品信息:								
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		史跃锋、李华		
采样日期		2023-02-27		检测日期		2023-02-28~2023-03-02		
采样方式		连续		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
FQ-049	氯化氢	SUP22401181	3.27	5.91×10 ⁻³	3478	10	---	33.5
		SUP22401182	0.75					
		SUP22401183	1.07					
		平均值	1.70					
烟气参数:								
烟气参数		烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h		
SUP22401181/ 182/183		24	3.8	103.1	0.2827	3478		
参照标准		《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3						
备注：1.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 2.排气筒高度由受检单位提供。								

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003 第 23 页 共 40 页

表 11:

样品信息:								
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		甘佳保、石双瑜		
采样日期		2023-02-27		检测日期		2023-02-28~2023-03-02		
采样方式		连续		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
FQ-021	氯化氢	SUP22401196	0.92	8.54×10 ⁻³	7235	10	---	25
		SUP22401197	1.29					
		SUP22401198	1.32					
		平均值	1.18					
烟气参数:								
烟气参数		烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²		标干流量 m³/h	
SUP22401196/ 197/198		22	4.4	102.8	0.5027		7235	
参照标准		《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3						
备注：1.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 2.排气筒高度由受检单位提供。								

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003 第 24 页 共 40 页

表 12:

样品信息:								
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		史跃锋、李华		
采样日期		2023-02-27		检测日期		2023-02-28		
采样方式		连续		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
FQ050	氨	SUP22401241	0.32	4.25×10 ⁻³	3763	10	---	33.5
		SUP22401242	1.76					
		SUP22401243	1.31					
		平均值	1.13					
烟气参数:								
烟气参数		烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa		截面 m²		标干流量 m³/h
SUP22401241		22	4.2	103.4		0.2827		3894
SUP22401242		22	4.1	103.4		0.2827		3796
SUP22401243		23	3.9	103.2		0.2827		3599
参照标准		《半导体行业污染物排放标准》（DB/3747-2020）表 3 大气污染物排放限值						
备注：1.排气筒高度由受检单位提供。								
2.“---”表示 DB/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。								

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003 第 25 页 共 40 页

表 13:

样品信息:								
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		史跃锋、李华		
采样日期		2023-02-27		检测日期		2023-02-27~2023-02-28		
采样方式		连续/瞬时		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
FQ051	氨	SUP22401244	0.37	9.81×10 ⁻⁴	2087	10	---	33.5
		SUP22401245	ND					
		SUP22401246	0.92					
		平均值	0.47					
	硫化氢	SUP22401250	ND	/	2042	---	1.80	
		SUP22401251	ND	/	2140			
		SUP22401252	ND	/	2080			
		最大值	ND	/	2140			
	臭气浓度	SUP22401247	269（无量纲）			15000（无量纲）		
		SUP22401248	354（无量纲）					
		SUP22401249	309（无量纲）					
		最大值	354（无量纲）					

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h
SUP22401244/250	22	3.9	103.4	0.1590	2042
SUP22401245/251	22	4.1	103.4	0.1590	2140
SUP22401246/252	24	4.0	103.2	0.1590	2080
参照标准	硫化氢、臭气浓度：《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 2 恶臭污染物排放标准值 氨：《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3				
备注：1.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。 2.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 3.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 和 GB 14554-1993 表 2 标准中未对该项目作限制。 4.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003 第 26 页 共 40 页

表 14:

样品信息:										
样品类型	工业废气（有组织）			采样人员	张立广、崔凯杰					
采样日期	2023-02-28			检测日期	2023-02-28~2023-03-06					
采样方式	连续/瞬时			样品状态	完好					
检测结果:										
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m		
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h			
FQ-023	二氧化硫	SUP22401403	ND	/	22814	200	1.4	33.5		
		SUP22401404	ND							
		SUP22401405	ND							
		平均值	ND							
	氮氧化物	SUP22401403	6	0.160	22814	100	0.47			
		SUP22401404	8							
		SUP22401405	8							
		平均值	7							
	颗粒物	SUP22401412	5.2	0.120	22672	20	1			
		SUP22401413	5.4							
		SUP22401414	5.3							
		平均值	5.3							
	异丙醇	SUP22401409	0.085	1.53×10 ⁻³	22884	40	---			
		SUP22401410	0.092							
		SUP22401411	0.024							
		平均值	0.067							
	非甲烷总烃	SUP22401406	1.84	4.33×10 ⁻²	22884	50	---			
		SUP22401407	1.90							
		SUP22401408	1.92							
		平均值	1.89							

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003 第 27 页 共 40 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h
SUP22401403/ 412	46	9.2	102.0	0.7854	22107
SUP22401404/ 405/406/409/413	45	9.6	102.0	0.7854	23167
SUP22401407/ 408/410/411/414	44	9.4	102.2	0.7854	22743
参照标准	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 1 大气污染物有组织排放限值 异丙醇、非甲烷总烃：《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3				
备注：1.氮氧化物、二氧化硫为现场检测。 2.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。 3.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 4.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 和客户提供限值中未对该项目作限制。 5.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003 第 28 页 共 40 页

表 15:

样品信息:										
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		史跃锋、李华				
采样日期		2023-02-28		检测日期		2023-02-28~2023-03-06				
采样方式		连续/瞬时		样品状态		完好				
检测结果:										
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m		
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h			
FQ-053	二氧化硫	SUP22401415	ND	/	22332	200	1.4	33.5		
		SUP22401416	ND							
		SUP22401417	ND							
		平均值	ND							
	氮氧化物	SUP22401415	4	0.112	22332	100	0.47			
		SUP22401416	5							
		SUP22401417	6							
		平均值	5							
	颗粒物	SUP22401424	5.9	0.121	22353	20	1			
		SUP22401425	4.8							
		SUP22401426	5.6							
		平均值	5.4							
	异丙醇	SUP22401421	0.236	3.82×10 ⁻³	22613	40	---			
		SUP22401422	0.146							
		SUP22401423	0.126							
		平均值	0.169							
	非甲烷总烃	SUP22401418	1.32	3.10×10 ⁻²	22613	50	---			
		SUP22401419	1.33							
		SUP22401420	1.46							
		平均值	1.37							

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003

第 29 页 共 40 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h
SUP22401415/ 416/420/423/ 425	40	9.2	102.5	0.7854	22572
SUP22401417/ 426	40	8.9	102.4	0.7854	21853
SUP22401418/ 419/421/422/ 424	40	9.2	102.5	0.7854	22634
参照标准	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 1 大气污染物有组织排放限值 异丙醇、非甲烷总烃：《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3				
备注：1.氮氧化物、二氧化硫为现场检测。 2.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。 3.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 4.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 和客户提供限值中未对该项目作限制。 5.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003 第 30 页 共 40 页

表 16:

样品信息:								
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		史跃锋、李华		
采样日期		2023-02-28		检测日期		2023-02-28~2023-03-06		
采样方式		连续/瞬时		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
FQ-024	二氧化硫	SUP22401427	ND	/	16080	200	1.4	33.5
		SUP22401428	3					
		SUP22401429	ND					
		平均值	ND					
	氮氧化物	SUP22401427	5	9.65×10 ⁻²	16080	100	0.47	
		SUP22401428	8					
		SUP22401429	5					
		平均值	6					
	颗粒物	SUP22401436	5.7	0.103	16336	20	1	
		SUP22401437	6.8					
		SUP22401438	6.5					
		平均值	6.3					
	异丙醇	SUP22401433	0.058	1.22×10 ⁻³	16080	40	---	
		SUP22401434	0.164					
		SUP22401435	0.007					
		平均值	0.076					
	非甲烷总烃	SUP22401430	1.46	2.38×10 ⁻²	16080	50	---	
		SUP22401431	1.48					
		SUP22401432	1.50					
		平均值	1.48					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003

第 31 页 共 40 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h
SUP22401427/ 428/430/431/ 433/434/437	50	6.7	102.2	0.7854	15911
SUP22401429/ 432/435/438	50	6.9	102.2	0.7854	16419
SUP22401436	50	7.0	102.2	0.7854	16677
参照标准	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 1 大气污染物有组织排放限值 异丙醇、非甲烷总烃：《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3				
备注：1.氮氧化物、二氧化硫为现场检测。 2.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。 3.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 4.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 和客户提供限值中未对该项目作限制。 5.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003 第 32 页 共 40 页

表 17:

样品信息:								
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		甘佳保、石双瑜		
采样日期		2023-02-27		检测日期		2023-02-28		
采样方式		连续		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
FQ-011	氨	SUP22401442	0.99	1.15×10 ⁻²	11785	10	---	33.5
		SUP22401443	0.72					
		SUP22401444	1.22					
		平均值	0.98					
烟气参数:								
烟气参数		烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa		截面 m²		标干流量 m³/h
SUP22401442		24	4.6	103.2		0.7854		11900
SUP22401443		24	4.6	103.1		0.7854		11762
SUP22401444		24	4.6	102.9		0.7854		11694
参照标准		《半导体行业污染物排放标准》（DB/3747-2020）表 3 大气污染物排放限值						
备注: 1.排气筒高度由受检单位提供。								
2.“---”表示 DB/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。								
3.FQ-011 管道直径 1.00m, 采样孔位于变径处下游 400cm, 采样孔直径 10cm。								

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003

第 33 页 共 40 页

表 18:

样品信息:								
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		甘佳保、石双瑜		
采样日期		2023-02-27		检测日期		2023-02-28		
采样方式		连续		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒 高度 m
						排放浓 度 mg/m³	排放 速率 kg/h	
FQ-006	氨	SUP22401445	ND	6.75×10 ⁻³	15010	10	---	33.5
		SUP22401446	0.44					
		SUP22401447	0.78					
		平均值	0.45					
烟气参数:								
烟气参数		烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa		截面 m²		标干流量 m³/h
SUP22401445		22	5.8	103.2		0.7854		15061
SUP22401446		22	5.9	102.9		0.7854		15107
SUP22401447		22	5.8	102.9		0.7854		14863
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》（DB/3747-2020）表 3 大气污染物排放限值							
备注：1.排气筒高度由受检单位提供。								
2.“---”表示 DB/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。								
3.FQ-006 管道直径 1.00m，采样孔位于变径处下游 400cm，采样孔直径 10cm。								
4.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。								

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003 第 34 页 共 40 页

表 19:

样品信息:								
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		甘佳保、石双瑜		
采样日期		2023-02-27		检测日期		2023-02-28		
采样方式		连续		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
FQ-016	氨	SUP22401448	1.40	1.80×10 ⁻²	17954	10	---	33.5
		SUP22401449	0.53					
		SUP22401450	1.06					
		平均值	1.00					
烟气参数:								
烟气参数		烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa		截面 m²		标干流量 m³/h
SUP22401448		23	7.0	103.1		0.7854		17997
SUP22401449		23	6.9	102.9		0.7854		17745
SUP22401450		23	7.1	102.9		0.7854		18121
参照标准		《半导体行业污染物排放标准》（DB/3747-2020）表 3 大气污染物排放限值						
备注: 1.排气筒高度由受检单位提供。								
2.“---”表示 DB/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。								
3.FQ-016 管道直径 1.00m，采样孔位于变径处下游 400cm，采样孔直径 10cm。								

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003 第 35 页 共 40 页

表 20:

样品信息:								
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		甘佳保、石双瑜		
采样日期		2023-02-27		检测日期		2023-02-28		
采样方式		连续		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
FQ-017	氨	SUP22401451	0.44	8.34×10 ⁻³	14890	10	---	33.5
		SUP22401452	0.51					
		SUP22401453	0.74					
		平均值	0.56					
烟气参数:								
烟气参数		烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa		截面 m²		标干流量 m³/h
SUP22401451		23	5.8	103.1		0.7854		14880
SUP22401452		23	5.9	102.9		0.7854		15081
SUP22401453		23	5.7	102.9		0.7854		14709
参照标准		《半导体行业污染物排放标准》（DB/3747-2020）表 3 大气污染物排放限值						
备注: 1.排气筒高度由受检单位提供。								
2.“---”表示 DB/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。								
3.FQ-017 管道直径 1.00m，采样孔位于变径处下游 400cm，采样孔直径 10cm。								

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003 第 36 页 共 40 页

表 21:

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
工业废气 (有组织)	氟化物	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20175240	2023-10-10
		大流量低浓度烟尘气测试仪	3012H-D 型 (18 款)	TTE20212601	2023-11-01
		大流量低浓度烟尘气测试仪	3012H-D 型 (18 款)	TTE20212603	2023-11-01
		离子计	PXSJ-216F	TTE20213340	2023-09-27
		大流量低浓度烟尘气测试仪	崂应 3012H-D 型 (21 款)	TTE20224564	2023-11-01
	颗粒物	大流量自动烟尘气采样器	ZR-3260D	TTE20178213	2023-11-30
		大流量低浓度烟尘气测试仪	3012H-D 型 (18 款)	TTE20212603	2023-11-01
		恒温恒湿称量设备	WZZ-M	TTF20191083	2023-10-19
	二氧化硫	大流量自动烟尘气采样器	ZR-3260D	TTE20178213	2023-11-30
		大流量低浓度烟尘气测试仪	3012H-D 型 (18 款)	TTE20212603	2023-11-01
	氮氧化物	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20175240	2023-10-10
		大流量自动烟尘气采样器	ZR-3260D	TTE20178213	2023-11-30
		大流量低浓度烟尘气测试仪	3012H-D 型 (18 款)	TTE20212601	2023-11-01
		大流量低浓度烟尘气测试仪	3012H-D 型 (18 款)	TTE20212603	2023-11-01
		大流量低浓度烟尘气测试仪	崂应 3012H-D 型 (21 款)	TTE20224564	2023-11-01

*** 本页完 ***

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003 第 37 页 共 40 页

续上表

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
工业废气 (有组织)	氯化氢	智能双路烟气采样器	崂应 3072	TTE20100112	2023-05-31
		离子色谱仪 (IC)	ICS-1100	TTE20120654	2023-04-14
		离子色谱仪 (IC)	Aquion	TTE20164915	2023-07-21
		双路烟气采样器	ZR-3710 型	TTE20171700	2023-03-30
		双路烟气采样器	ZR-3710 型	TTE20171701	2023-03-30
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20175240	2023-10-10
		大流量自动烟尘气采样器	ZR-3260D	TTE20178213	2023-11-30
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200002	2024-01-02
		双路烟气采样器	ZR-3712	TTE20212467	2023-08-30
		大流量低浓度烟尘气测试仪	3012H-D 型 (18 款)	TTE20212601	2023-11-01
		大流量低浓度烟尘气测试仪	3012H-D 型 (18 款)	TTE20212603	2023-11-01
		双路烟气采样器	ZR-3712	TTE20221876	2023-06-30
		大流量低浓度烟尘气测试仪	崂应 3012H-D 型 (21 款)	TTE20224564	2023-11-01
	硫酸雾	离子色谱仪 (IC)	Aquion	TTE20164915	2023-07-21
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20175240	2023-10-10
		大流量低浓度烟尘气测试仪	3012H-D 型 (18 款)	TTE20212601	2023-11-01
		大流量低浓度烟尘气测试仪	3012H-D 型 (18 款)	TTE20212603	2023-11-01
		大流量低浓度烟尘气测试仪	崂应 3012H-D 型 (21 款)	TTE20224564	2023-11-01

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003 第 38 页 共 40 页

续上表

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
工业废气 (有组织)	氯气	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20175240	2023-10-10
		双路 VOCs 采样器	ZR-3710B 型	TTE20191316	2023-05-09
		双路 VOCs 采样器	ZR-3713	TTE20202193	2024-01-02
		双路 VOCs 采样器	ZR-3713	TTE20202196	2024-01-02
		大流量低浓度烟尘气测试仪	3012H-D 型 (18 款)	TTE20212601	2023-11-01
		大流量低浓度烟尘气测试仪	3012H-D 型 (18 款)	TTE20212603	2023-11-01
		紫外可见分光光度计 (UV)	UV-7504	TTE20213126	2023-09-27
		大流量低浓度烟尘气测试仪	崂应 3012H-D 型 (21 款)	TTE20224564	2023-11-01
	非甲烷总烃	气相色谱仪 (GC)	GC-2014	TTE20141318	2023-09-19
		大流量自动烟尘气采样器	ZR-3260D	TTE20178213	2023-11-30
		大流量低浓度烟尘气测试仪	3012H-D 型 (18 款)	TTE20212603	2023-11-01
	硫化氢	双路烟气采样器	ZR-3710 型	TTE20171700	2023-03-30
		大流量自动烟尘气采样器	ZR-3260D	TTE20178213	2023-11-30
		紫外可见分光光度计 (UV)	UV-7504	TTE20213126	2023-09-27

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003 第 39 页 共 40 页

续上表

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
工业废气 (有组织)	氨	双路烟气采样器	ZR-3710 型	TTE20171700	2023-03-30
		双路烟气采样器	ZR-3710 型	TTE20171701	2023-03-30
		大流量自动烟尘 气采样器	ZR-3260D	TTE20178213	2023-11-30
		自动烟尘烟气综 合测试仪	ZR-3260	TTE20200002	2024-01-02
		紫外可见分光光 度计 (UV)	UV-7504	TTE20213126	2023-09-27
	异丙醇	气相色谱质谱联 用仪 (GCMS)	QP-2010Ultra	TTE20150799	2023-04-19
		大流量自动烟尘 气采样器	ZR-3260D	TTE20178213	2023-11-30
		大流量低浓度烟 尘气测试仪	3012H-D 型 (18 款)	TTE20212603	2023-11-01
		吸附管法双路环 境空气 VOCs 采 样仪	2061 型	TTE20224466	2023-11-01

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094152CQ003 第 40 页 共 40 页

表 22:

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
工业废气 (有组织)	氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001	0.06mg/m ³
	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0mg/m ³
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	3mg/m ³
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m ³
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.2mg/m ³
	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	0.2mg/m ³
	氯气	固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度 法 HJ/T 30-1999	0.2mg/m ³
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测 定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(国家环保总局 2003 年 第四版增补版) 第五篇 第四章 十 (三)	0.01mg/m ³
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25mg/m ³
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋 法 HJ 1262-2022	/
	异丙醇	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附 -热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	0.002mg/m ³

报告结束